

MPI TS2000-HP | ShieldEnvironment™付200 mmハイパワー用オート・プローバー

最大10 kV/600Aハイパワー・オート・プローバー

ライトカーテン

- インターロック制御されたライト・カーテンによりオペレータが誤ってプローバーに侵入した場合に機械を安全に停止

アーク放電防止技術

- ArcShield™ 技術によりチャックとプローブ・プラテン間のアーク放電を防止することが可能
- アーク放電防止プローブ・カードはDUTに高空気圧をかけ、パッシェンの法則に基づいてパッド間のアーク放電を防止
- アーク放電防止設計されたフロリナートレーLiquidTray™はチャックに載せることによりアーク放電を抑えることが可能

ポジションおよびハイパワープローブ

- 最大RF 4台またはハイパワー用8台まで搭載可能
- さまざまなポジションより選定可能
- 同軸/トライアキシャル、高電圧/大電流専用プローブアームをご用意(最大400 A/バルス)

プローブ・プラテン

- 高剛性、安定設計
- 熱安定性を高めるエアークリング機構
- 修理・メンテナンス用独自設計

モジュール式チャック

- さまざまな常温、温度チャック
- 広温度範囲に対応可能(下限温度-60℃から上限温度300℃まで)
- フィールドにてアップグレード可能
- MPI独自のトライアキシャル・チャック・コネクタにより、チャック接続を変更することなく超低雑音3 kV(トライアキシャル)、10 kV(同軸)のテストセットアップを変更することが可能

ShieldEnvironment™

- EMIシールド、遮光環境により、超低ノイズ・低キャパシタンス測定を実現
- 広い前面ドアよりIC/ウェハーの出し入れが簡単に

Vertical Control Environment™ (VCE)

- VCE™機能によりプローブ先端を側面から表示することが可能になり、プローブカードのチップ・ドロップに関係なくコンタクト・ポジションまで自動化
- プローブ・カードでもDC/RF針でも、特にShieldEnvironment™のチャンパー内での安全な測定が可能に



Safety Test Management™ (STM) System

- さまざまな温度下において測定環境が守られ、安全で、より信頼性の高い測定が可能に
- 露点コントロール機能により低温での測定を安定に実施
- 自動でCDAあるいは窒素の流量を監視
- 流量不足や流れが止まるなどの問題が起こった場合、自動的にチャックをセーフモードに切り替え

プローバー制御ソフトウェアSENTIO®

- 簡単で直感的な操作、画期的なマルチ・タッチ式コントロールによりトレーニング時間を大幅に削減
- スクロール、ズーム、ムーブコマンドはスマートフォンの操作と似ているため誰でもすぐに操作が可能
- 現在使用中のアプリケーションから他のアプリケーションへの移動は指をスワイプするだけで可能
- 校正用ソフトウェアQAibria®はSENTIO®は完全統合されており、同じコンセプトのもとに設計されているため、非常に簡単に使いこなすことが可能
- リモート制御用GPIB, TCP/IPインタフェース

顕微鏡および顕微鏡オプション

- 堅牢なプログラマブル顕微鏡ブリッジ・マウント(50 x 50 x 140 mm)
- さまざまな顕微鏡より選定可能(単眼鏡、デジタル顕微鏡など)

温度制御

- プローバー本体に組み込まれた前面にタッチパネルにより簡単にすぐに温度の制御が可能に

ハードウェア・コントロール・パネル

- より早く、より安全に、より簡単にプローバーを制御できるようコントロールシステムが集約
- キーボードおよびマウスは操作しやすい位置に。またWindows®ベースの計測器も制御可能

シングル・ウェハー・ローダー

- 自動測定のためのプリアライメント機能ウェハー・ローディング
- 100/150/200 mmウェハーに対応

高低温時ウェハー交換が可能に

- どのチャック温度でもウェハーのロード/アンロードが可能
- ダウンタイムが大幅に削減され、効率的に測定が可能に

高性能防振機構

- 高性能防振プラットフォームと一体型
- 省スペース設計
- 測定器用トレーの設置により、ケーブル長を短くし、測定をより確実に(オプション)